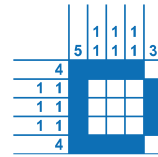
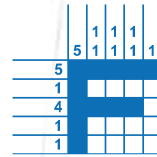
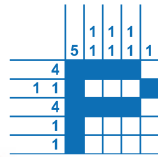
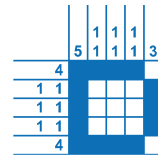
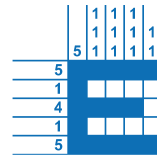
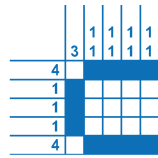


# 凝集沈殿処理装置 加圧浮上処理装置



Series



Type: CED

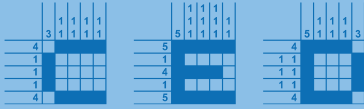


Type: PFD

凝集処理とは 水中の微細な浮遊物質やコロイド状物質を凝集剤によりフロック(水に凝集剤を混和させたとき、形成される凝集体)をつくり 高分子凝集剤で更にフロックを粗大化させ 固液分離する装置です。

凝集沈殿処理装置はイオン化した重金属をキレート剤等の凝集剤により化学反応させて 沈降分離除去します。

加圧浮上処理装置は油分等を含む沈降しづらいフロックを気泡により浮上させて分離除去します。



# 凝集沈殿処理装置

Type: CED



ごみ焼却場排水 1.5m<sup>3</sup>/hr 処理



工場排水 4m<sup>3</sup>/hr 処理



エッチング排水 バッチ凝沈 1m<sup>3</sup>/回



洗浄水排水 バッチ凝沈 0.7m<sup>3</sup>/回

凝集沈殿処理とは 水中の微細な浮遊物質やコロイド状物質を凝集剤によりフロック(水に凝集剤を混和させた時形成される凝集体)をつくり高分子凝集剤で更にフロックを粗大化させ 固液分離する装置です。  
また イオン化した重金属をキレート剤等の凝集剤により化学反応させて 沈降分離除去します。

型式	最大処理能力	沈殿槽φ	装置重量 (t)	運転重量 (t)
CED-01	1m <sup>3</sup> /Hr	1,200	1.3	3.7
CED-02	2m <sup>3</sup> /Hr	1,600	2.0	7.2
CED-04	4m <sup>3</sup> /Hr	2,000	2.8	12.4
CED-08	8m <sup>3</sup> /Hr	2,600	5.4	24.0
CED-12	12m <sup>3</sup> /Hr	3,000	7.0	34.2

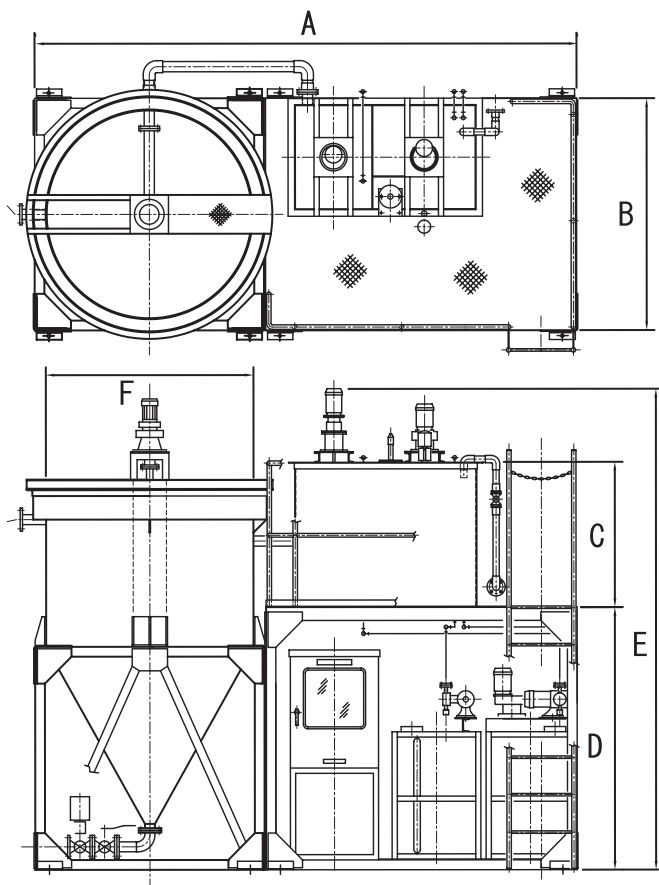
## 特徴

- 当社の処理装置はコンパクトにユニット化しており狭い設置場所にも対応可能です
- 独自の凝集剤を使用することによって装置のコストダウンを実現しました
- 全てユニット化しており処理量にあわせて機種選定が容易です
- 経験豊富な技術陣が排水に合わせた個別設計に対応しております

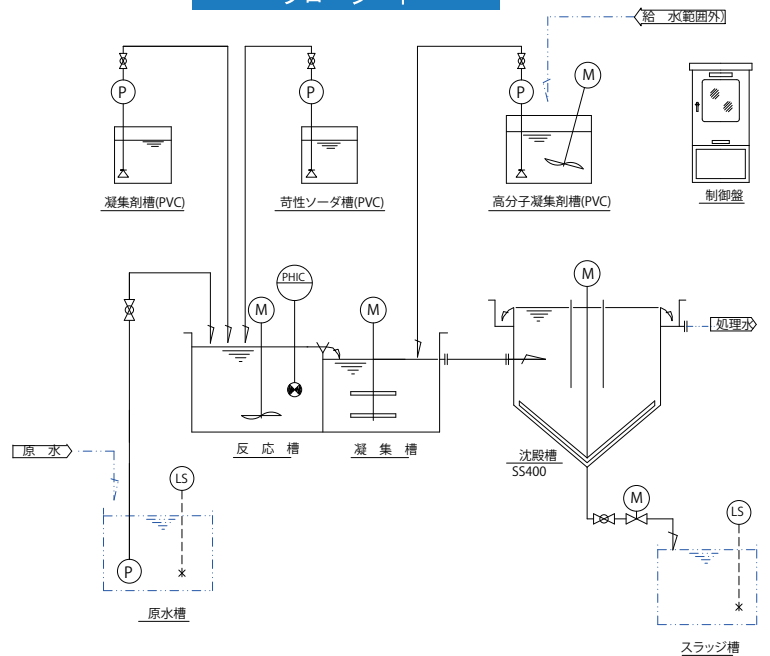
## 用途向先

- 土木・建築現場排水
- 金属表面処理工場
- ごみ焼却場排水処理装置
- 石材 スレート 生コン2次製品工場
- 各種洗浄排水
- 埋立地浸漬水排水処理装置
- 排ガス装置排水処理
- 各種実験室 研究室排水処理装置
- その他産業排水

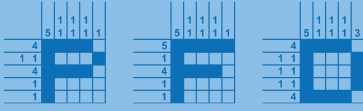
## 寸法図



## フローシート



型式	A 参考寸法	B	C	D	E 参考寸法	F
CED-01	3,460	1,350	1,350	1,700	3,050	1,200
CED-02	4,180	1,770	1,770	2,000	3,665	1,600
CED-04	4,780	2,170	2,170	2,000	3,807	2,000
CED-08	6,490	2,400	2,400	2,900	4,713	2,600
CED-12	7,175	2,400	2,400	3,550	5,468	3,000



# 加圧浮上処理装置

Type:PFD



加圧浮上処理装置 寒冷地仕様



凝集フロック



スカムの掻き取り



スカムの掻き取り

加圧浮上処理装置では、高圧で溶かした空気を含む水を、凝集槽からの処理水配管内に送り込みます。更に、浮上槽で大気圧に減圧され、微細な泡が発生し、この微細な泡がSS成分に付着し表層に浮いてきます。このスカムを掻き取って、スカム槽へ抜き出します。最終、このスカムは脱水機にかけ固液分離します。

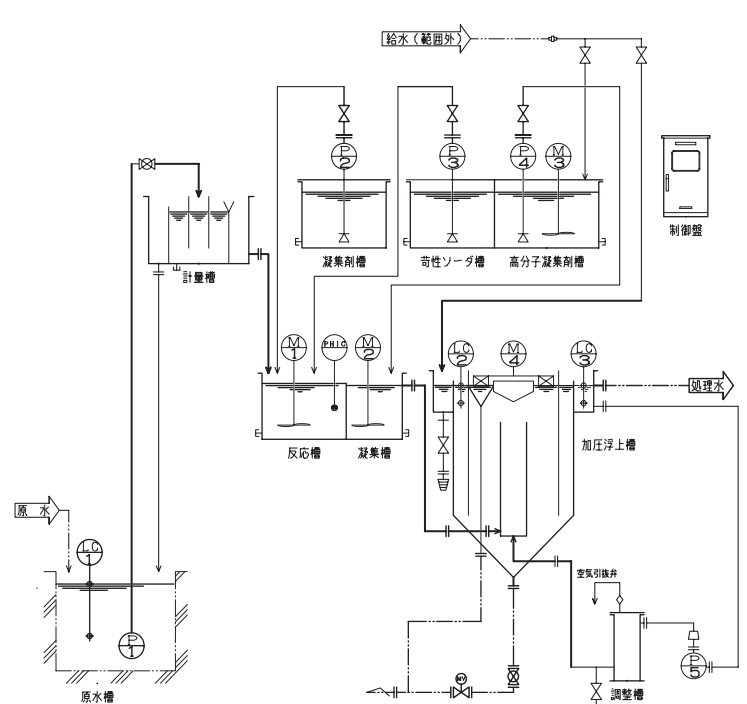
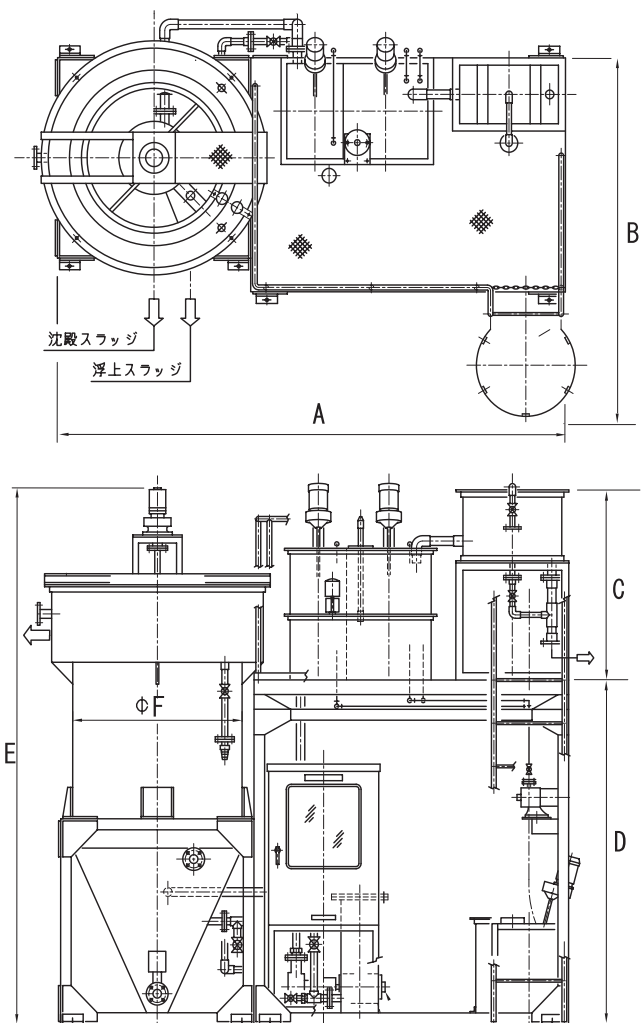
型式	最大処理量	加圧浮上槽φ	装置重量 (t)	運転重量 (t)
PFD-01	1.0m <sup>3</sup> /Hr	900	2.4	4.5
PFD-03	2.5m <sup>3</sup> /Hr	1,200	3.0	6.5
PFD-05	5.0m <sup>3</sup> /Hr	1,600	3.8	10.7
PFD-08	7.5m <sup>3</sup> /Hr	1,800	4.6	13.0
PFD-10	10.0m <sup>3</sup> /Hr	2,000	6.0	19.5

従来の沈降しにくい懸濁物質を含む排水には、凝集沈殿ではなく加圧浮上処理装置を使用します。

- リネン廃水
- バレル研磨廃水
- ボンデライト廃水
- 食品廃水
- 洗浄排水
- ダイカスト離型材廃水
- 塗装廃水
- 洗車廃水
- その他廃水

## 寸法図

## フローシート



型式	A 参考寸法	B	C	D	E 参考寸法	F
PFD-01	3,100	2,350	1,200	2,050	3,230	900
PFD-03	3,600	2,500	1,300	2,350	3,700	1,200
PFD-05	4,100	2,720	1,500	2,500	4,150	1,600
PFD-08	4,600	2,930	1,500	2,800	4,400	1,800
PFD-10	4,900	3,130	1,600	3,000	4,800	2,000

## pH 関連機器

ケミカルハンディポンプ



type: CXPC, CXS, CXSC, CXP, CXT

チューブポンプ



type: CZT

薬液タンク



PVC タンク  
50L~1000L

大型 PE タンク 200L~50000L

## 工業用計測機器



pH指示調節計  
type: CP-48



ペーパー式 pH指示記録計  
type: CER-110



ペーパーレス SDカード pH指示記録計  
type: CER-210



pH複合電極  
type: 8014  
L=5~15m



pH電極ホルダー(金具付)

## 消耗品・その他

- pH記録計(CER-110)用 記録紙
- pH記録計(CER-110)用 替ペン
- シーズマイルド(pH電極洗浄剤)
- フロート式レベルスイッチ (LS-S1)
- 2芯シールドケーブル
- 中継ボックス (CT-C型)



■ pH電極内部液 KCL(3.3mol/L)  
pH校正用試薬(pH4.01、pH6.86)  
500cc

■ シーズマイルド (pH電極洗浄剤)  
500cc

## 水処理装置 及び 各種装置 ※各種装置についてはご要望により設計いたします



自動pH中和処理装置  
薬品注入方式(PHU・PHE型)



炭酸ガス注入方式(PHG型)



樹脂製ろ板 脱水機  
フィルタープレス

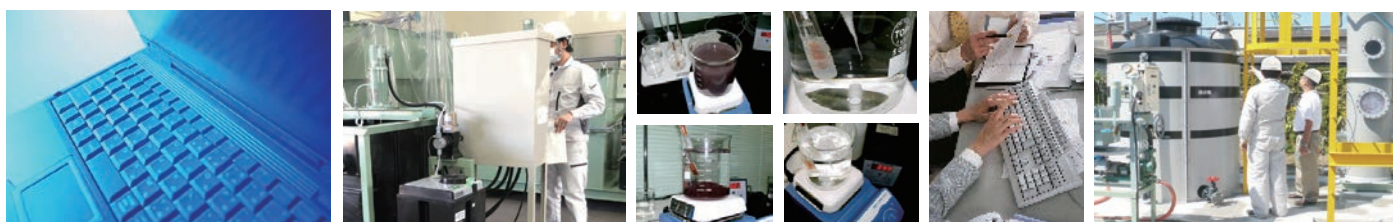


消臭剤噴霧装置  
type: MSD



排ガス処理装置  
type: YT

## メンテナンス



- 各種メンテナンス契約も承っております
- 排水処理設備の導入には必ずジャーテストが必要です

**cees** シーズ株式会社

〒550-0006  
大阪市西区江之子島1-6-2 奥内第8号ビル10階  
tel: 06-6167-8006 fax: 06-6167-8007

<https://cees.jp>  
info@cees.jp

排水処理 シーズ

検索

